

豊田工業大学 ARIM登録装置 利用価格表 (2025年4月1日 改定)

(¥/1h)

機器ID	装置名 (和文)	メーカー名 (和文)	型番	大分類	中分類	標準価格		アカデミック価格(大学等)	
						データ提供無	データ提供有	データ提供無	データ提供有
TT-001	スパッタ (金属、絶縁体) 蒸着装置	芝浦エレテック	CFS-4ES	成膜装置	スパッタリング (スパッタ)	2,400	1,800	1,800	1,200
TT-002	多機能薄膜作製装置	アルバック	BC2925 (特注装置)	成膜装置	スパッタリング (スパッタ)	2,400	1,800	1,800	1,200
TT-003	原子層堆積装置	Ultratech/Cambridge Nano Tech	Fiji F200	成膜装置	原子層堆積(ALD)装置	4,200	3,150	3,150	2,100
TT-005	マスクレス露光装置	大日本科研	MX-1204	リソグラフィ	光露光 (マスクレス、直接描画)	1,400	1,050	1,050	700
TT-006	マスクアライナ装置	ズース・マイクロテック	MA6	リソグラフィ	光露光 (マスクアライナ)	1,400	1,050	1,050	700
TT-007	レジスト処理 (アッシング) 装置	VICインターナショナル	VPA-100改造	膜加工・エッチング	プラズマエッチング	1,000	750	750	500
TT-008	洗浄ドラフトー式	東朋テクノロジー	特注	表面処理・洗浄	ウェット処理	400	300	300	200
TT-009	シリコン専用の各種熱処理 (酸化、拡散) 装置一式	縦型：ディー・エス・アイ テクノロジー 横型：光洋サーモシステム	縦型：MD-100P 横型：4001PSI	熱処理・ドーピング	酸化	1,600	1,200	1,200	800
TT-010	Reactive Ion Etching 装置 (非Boschプロセス)	サムコ	RIE-10NR	膜加工・エッチング	プラズマエッチング	2,800	2,100	2,100	1,400
TT-011	Deep Reactive Ion Etching装置 (Boschプロセス)	住友精密工業	Multiplex-ASE-SRE-SE	膜加工・エッチング	プラズマエッチング	3,200	2,400	2,400	1,600
TT-012	イオンミリング装置	日立ハイテクフィールディング	IM-4-1	膜加工・エッチング	プラズマエッチング	1,600	1,200	1,200	800
TT-013	ダイシング装置	岡本工作機械製作所	ADM-6DBV	組立・パッケージング	ダイシング、スクライバ	1,200	900	900	600
TT-014	電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM) (電子ビーム描画機能付属)	日本電子	JSM6500F	電子顕微鏡	走査型電子顕微鏡	1,800	1,350	1,350	900

豊田工業大学 ARIM登録装置 利用価格表 (2025年4月1日 改定)

(¥/1h)

機器ID	装置名 (和文)	メーカー名 (和文)	型番	大分類	中分類	標準価格		アカデミック価格(大学等)	
						データ提供無	データ提供有	データ提供無	データ提供有
TT-015	デジタルマイクロスコープ群	キーエンス	VHX-600、VH-5500など	光学顕微鏡	その他	400	300	300	200
TT-016	エリプソメーター	ガートナー	LSE	その他分析装置	エリプソメーター	400	300	300	200
TT-017	表面形状測定器 (段差計)	KLAテンコール	アルファーステップ IQZ	その他分析装置	段差計	1,000	750	750	500
TT-019	ナノ物性測定用 プローブ顕微鏡システム	ブルカー	Multimode顕微鏡	走査型プローブ顕微鏡	走査型トンネル顕微鏡	1,200	900	900	600
TT-020	ラマン分光装置	レニショー	inVia Reflex	分光・表面分析	ラマン分光	1,200	900	900	600
TT-021	偏光顕微鏡 (青色レーザー照射可能)	ネオアーク	特注	光学顕微鏡	その他	1,400	1,050	1,050	700
TT-022	磁気光学効果測定装置	豊田マックス	特注	光学顕微鏡	その他	1,400	1,050	1,050	700
TT-031	電子ビーム描画装置	クレストック	CABL-AP50S/RD	リソグラフィ	電子線描画 (EB)	2,400	1,800	1,800	1,200
TT-032	三次元形状測定機	キーエンス	VR-6200	光学顕微鏡	その他	1,000	750	750	500
TT-033	MEMS用統合解析ソフト	インテリセンス	IntelliSuite	理論計算・シミュレーション	CAD	400	300	300	200
TT-034	反応性プラズマ蒸着 (RPD) 装置	住友重機械工業	RPD-PCS4/LC	成膜装置	その他	2,400	1,800	1,800	1,200
TT-035	スパッタ・電子ビーム蒸着複合装置	ムーアフィールド	MiniLab-ES125A EB	成膜装置	スパッタリング (スパッタ)	2,400	1,800	1,800	1,200
TT-036	触針式プロファイラ (段差計) (Alpha-Step D-500)	KLA	Alpha-Step D-500	膜厚・粒度測定	段差計	1,000	750	750	500
TT-037	3次元光学プロファイラー (NewView9000)	ザイゴ	NewView9000	光学顕微鏡	その他	1,000	750	750	500